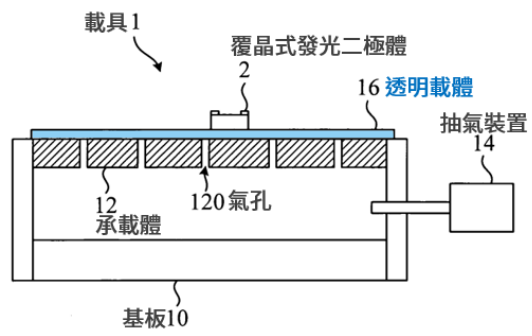
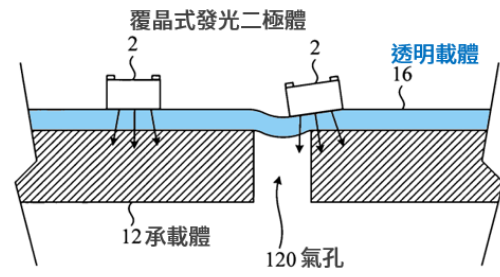


系爭專利圖 1A、1B：



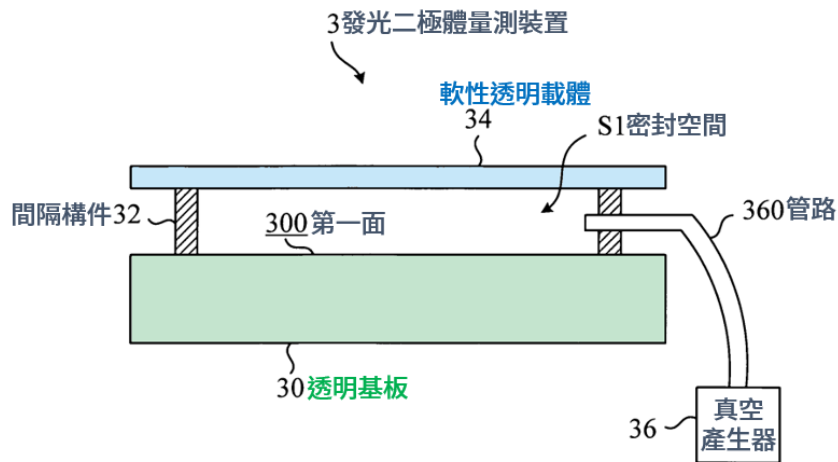
系爭專利圖1A



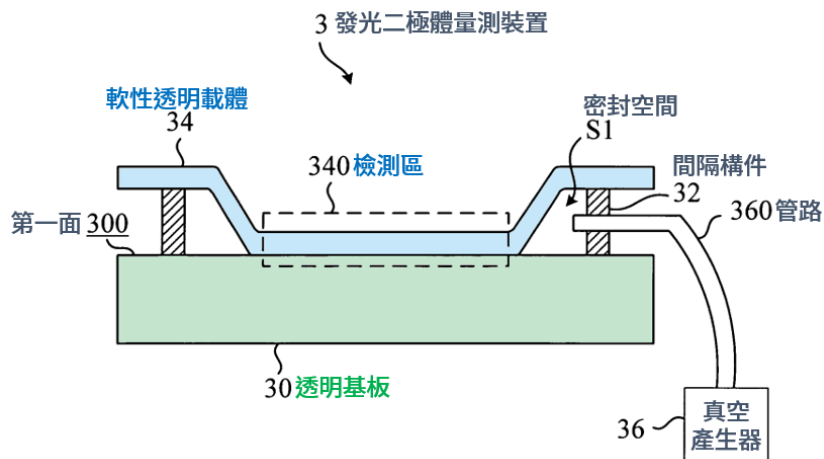
系爭專利圖1B

系爭專利主要圖式：

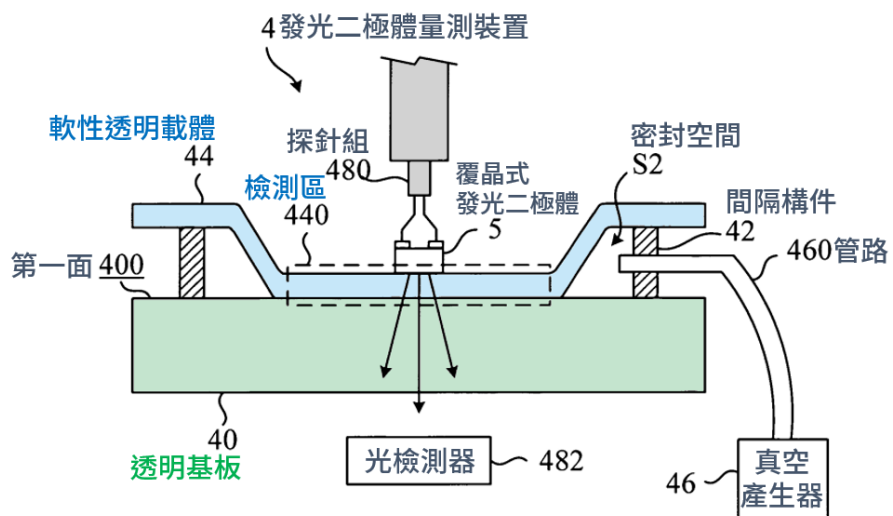
1、系爭專利圖 2 係發光二極體量測裝置的剖面示意圖



2、系爭專利圖 3 係真空產生器對密閉空間抽氣的剖面示意圖



3、系爭專利圖 4 係量測覆晶式發光二極體的剖面示意圖

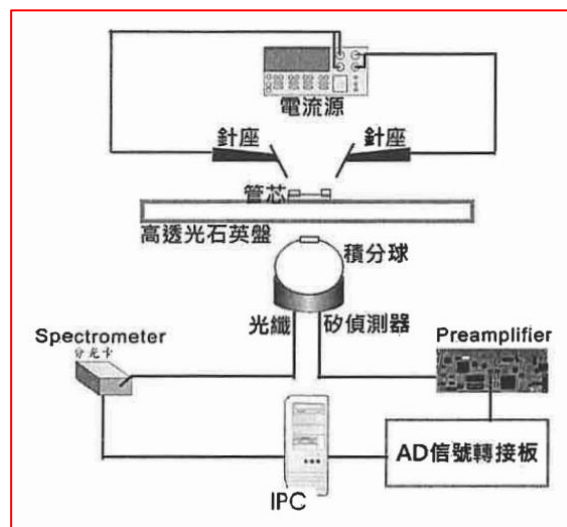


系爭產品照片

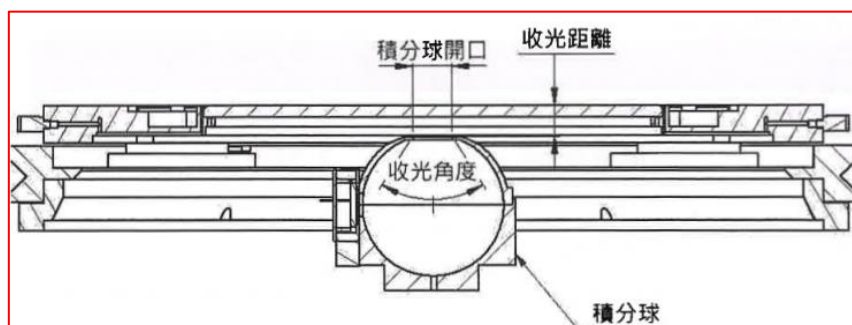
原證 6 第 5 頁（見原審卷(一)第 79 頁）



原證 5 第 4 頁（見原審卷(一)第 67 頁）

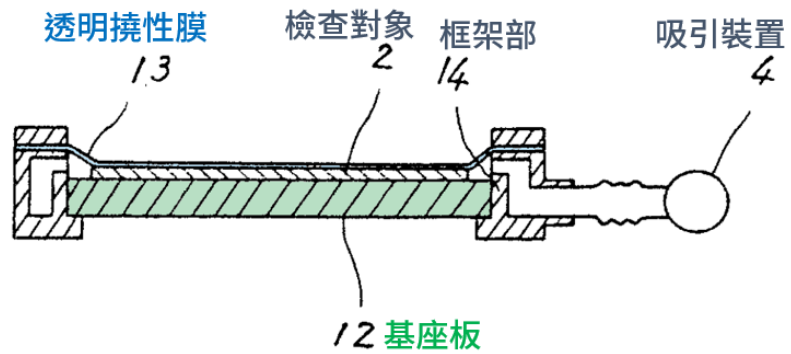


原證 5 第 7 頁圖（見原審卷(一)第 70 頁）

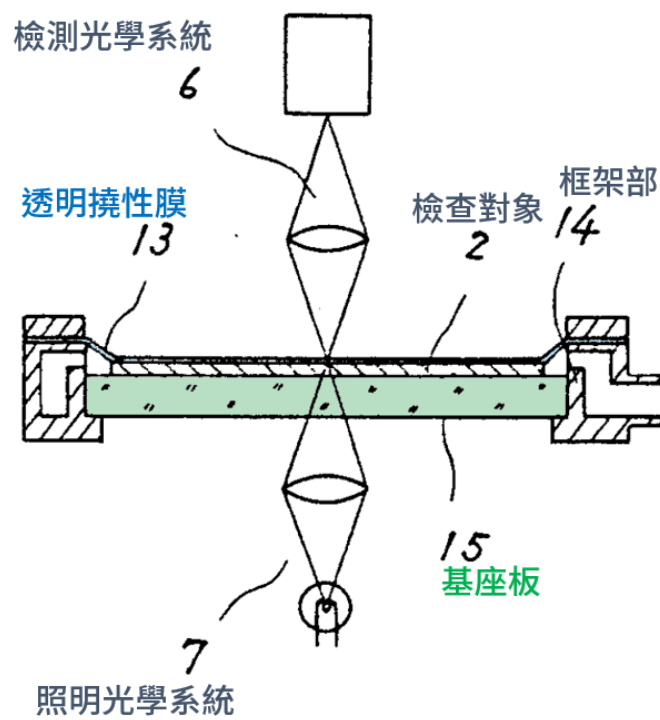


乙證 1 主要圖式：

乙證 1 圖 1 係圖案檢測裝置之固定裝置之示意圖

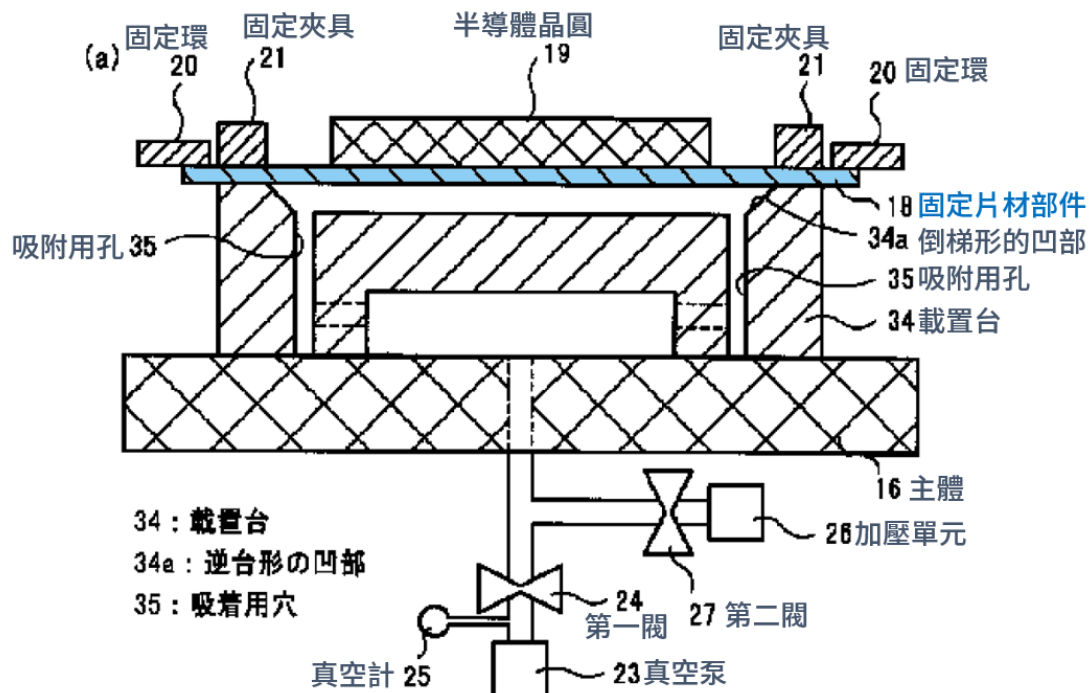


乙證 1 圖 2 係固定裝置之說明圖

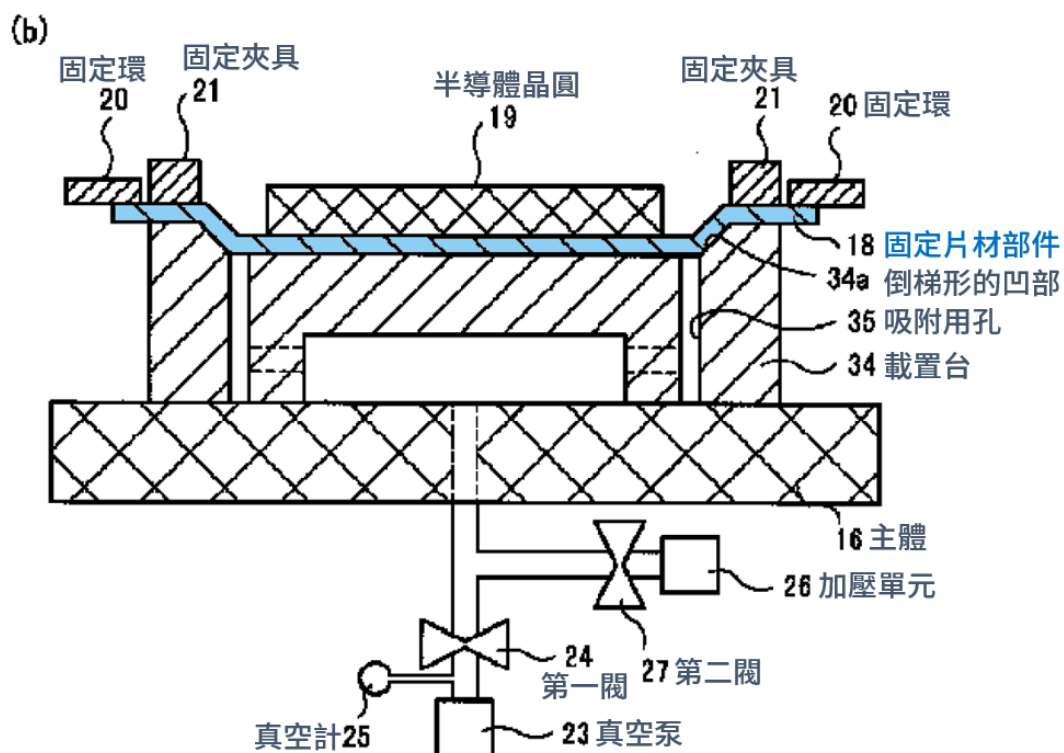


乙證 2 主要圖式：

乙證 2 圖 4(a)是鐳射加工裝置之結構示意圖

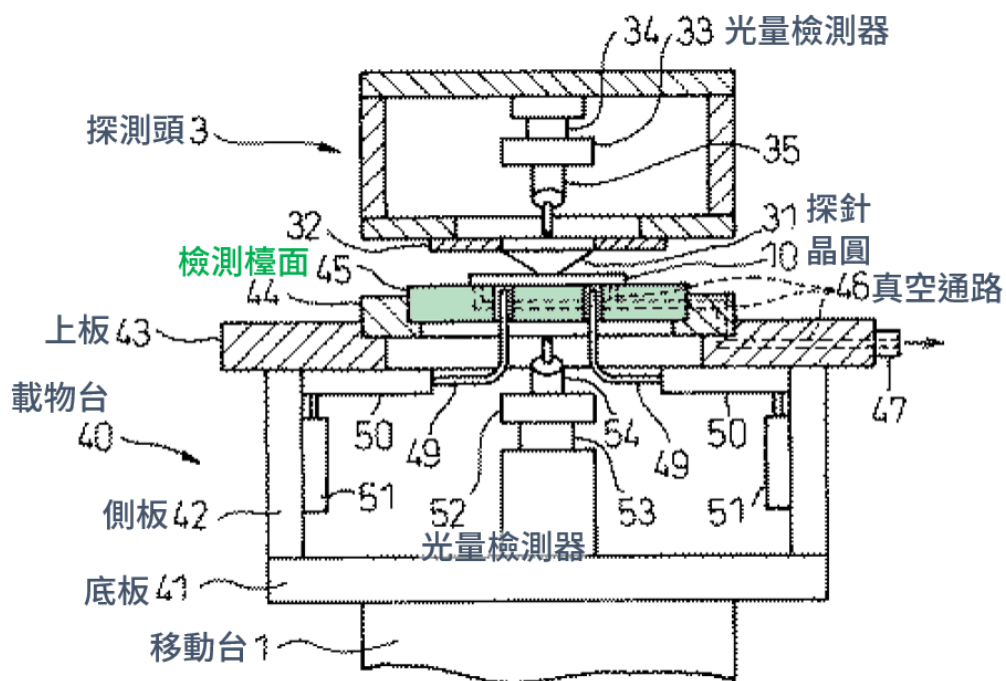


乙證 2 圖 4(b)是鐳射加工裝置之結構示意圖



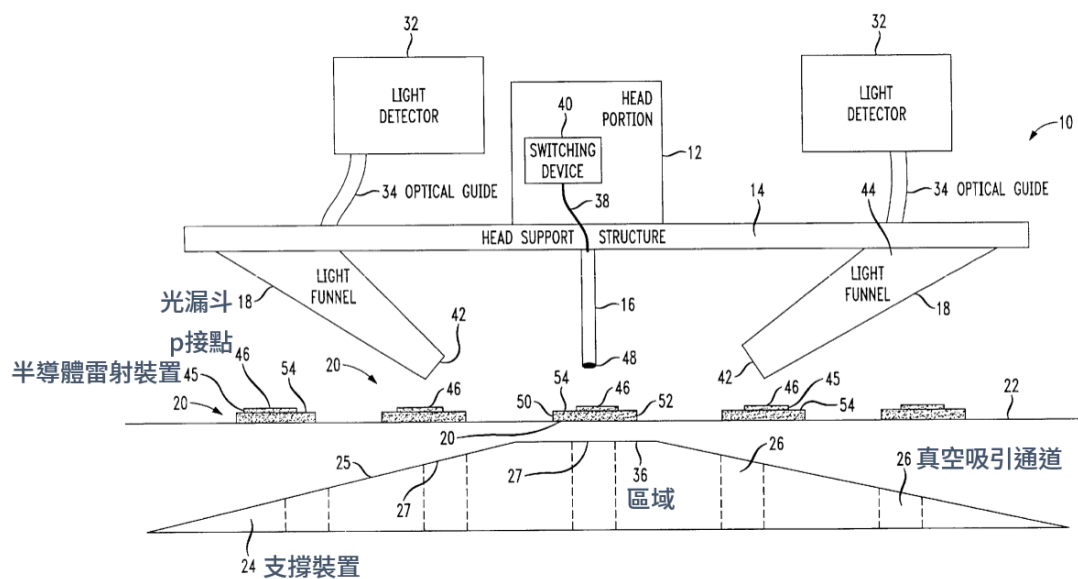
乙證 3 主要圖式：

乙證 3 圖 2 為雙面發光元件探測器之示意圖



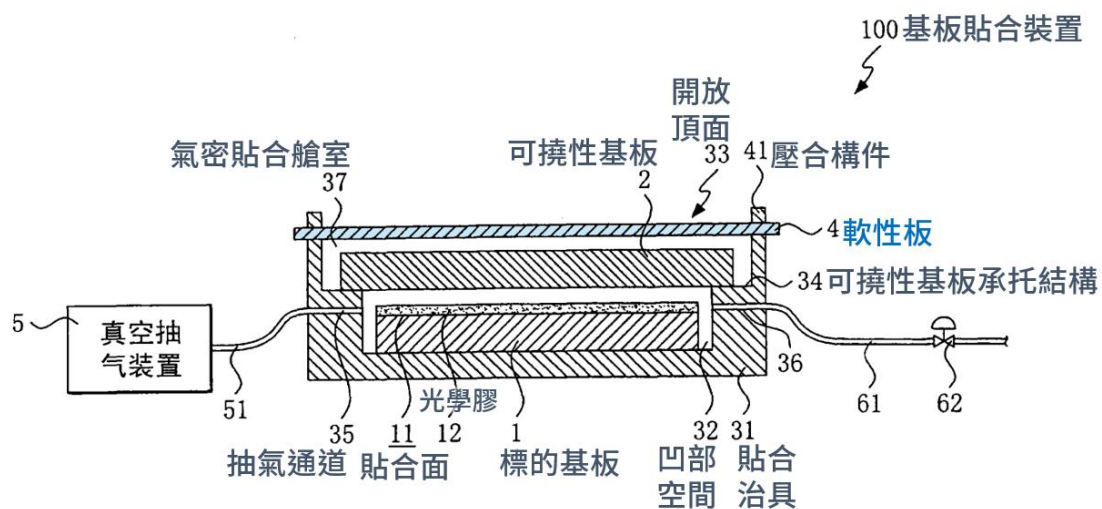
乙證 4 主要圖式：

乙證 4 圖 1 係半導體雷射或 LED 測試設備的示意圖



乙證 6 主要圖式：

乙證 6 圖 2 係基板貼合裝置第一實施例的剖視圖



乙證 6 圖 3 係基板貼合動作示意圖

